ダイヤモンド中窒素空孔中心を用いた 電子スピン多周波制御による 温度と磁場の複合センシング

早瀬研究室 中橋 克弥

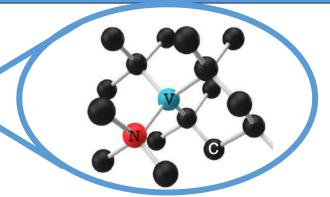
Department of Applied Physics and Physico-Informatics, Keio University

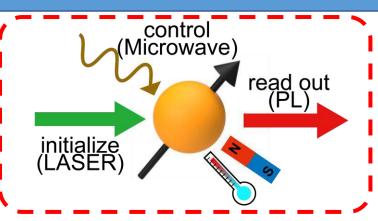
- 1. 研究背景
 - ・NVセンター
 - ・単一周波制御と多周波制御
- 2. 測定理論
 - ・エネルギー準位
 - ・ラムゼーシークエンス
 - ·多周波制御測定
- 3. 実験結果
- 4. まとめ

- 1. 研究背景
 - ・NVセンター
 - ・単一周波制御と多周波制御
- 2. 測定理論
 - ・エネルギー準位
 - ・ラムゼーシークエンス
 - ·多周波制御測定
- 3. 実験結果
- 4. まとめ

窒素空孔中心(NVセンター)







Zeeman effect

Dipole interaction

Hamiltonian

$$H \simeq \gamma_e \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} +$$

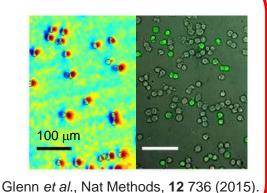
$$D S_Z^2 + d E_{\perp} (S_x^2 - S_y^2)$$

ベクトル磁場センシング

温度センシング

電場センシング

磁場センシング



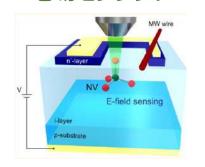
-5 (ωπ) λ 5 NV₁

Kucsko et al., Nature, 500 54 (2013).

5 10 15

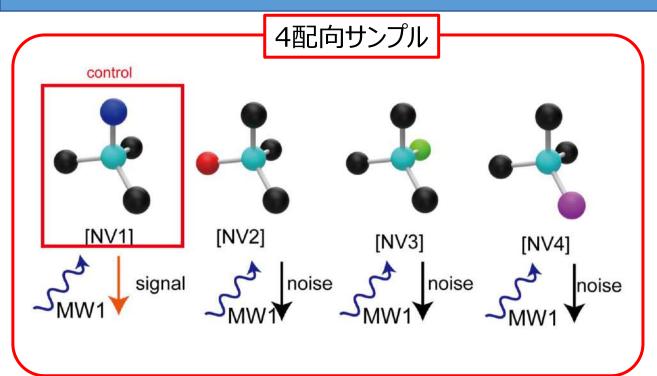
温度センシング

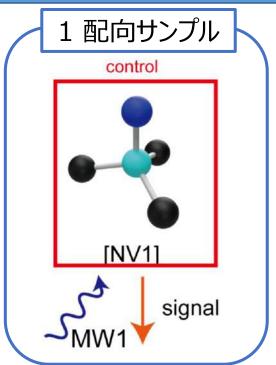
電場センシング



Iwasaki et al., ACS nano, 11 1238 (2017).

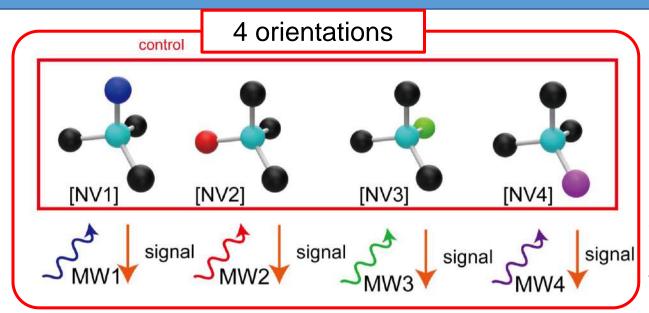
単一周波制御センシング





単一周波制御センシング				
4 配向	NV 配向	1 配向		
	ベクトル磁場測定	×		
	温度測定	0		

多周波制御センシング



S.Kitazawa, *et al.*, Phys. Rev. **A 96**, 042115 (2017). K.Yahata *et al.*, Appl. Phys. Lett., **114**, 022404 (2019).

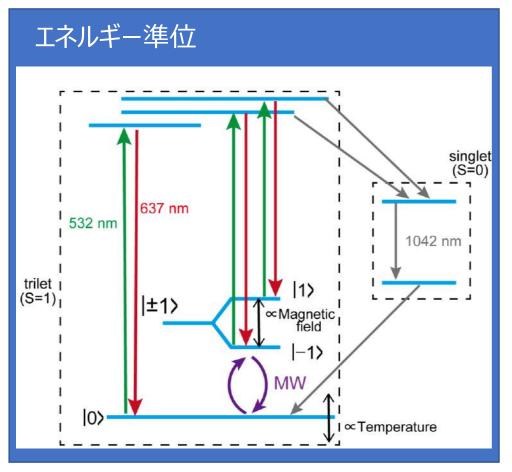
単一周波制	御センシング		多周波制御センシング
4 配向	1 配向	NV 配向	4 配向
	×	ベクトル磁場 センシング	O
	0	温度センシング	O

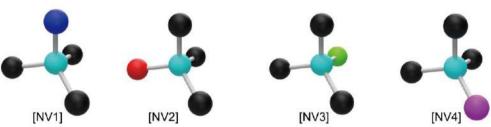
Research Purpose

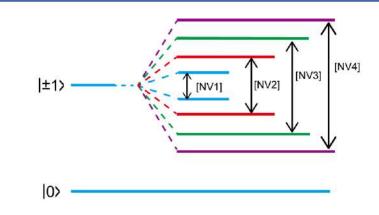
多周波制御センシングを用いた温度とベクトル磁場の複合測定

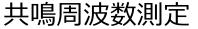
- 1. 研究背景
 - ・NVセンター
 - ・単一周波制御と多周波制御
- 2. 測定理論
 - ・エネルギー準位
 - ・ラムゼーシークエンス
 - ·多周波制御測定
- 3. 実験結果
- 4. まとめ

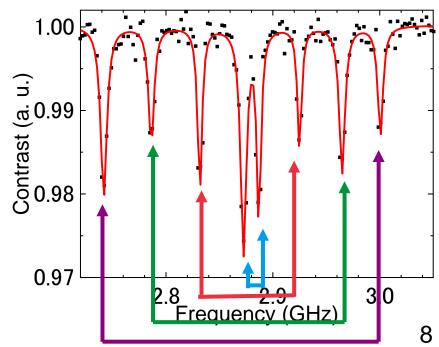
NVセンターのエネルギー準位



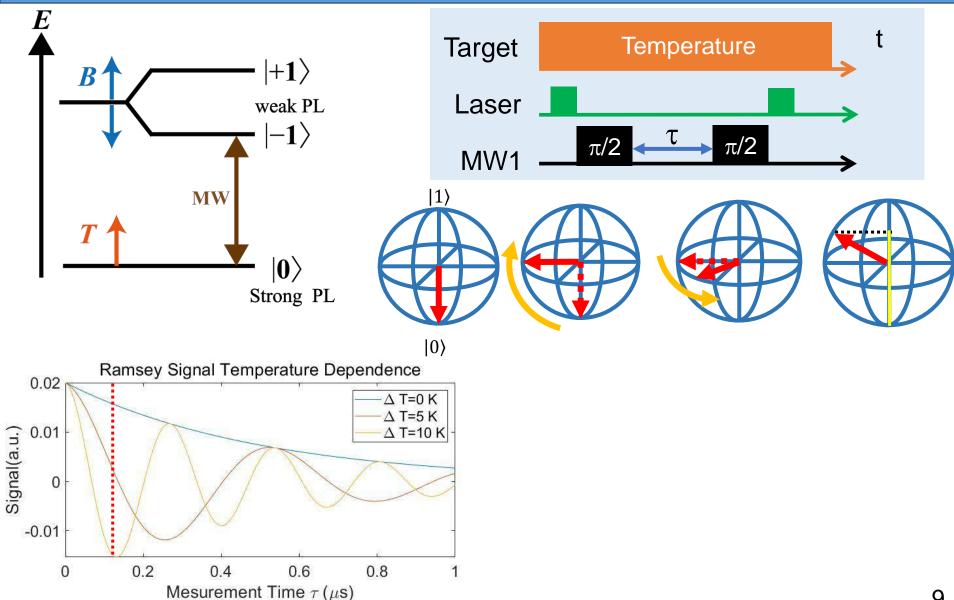




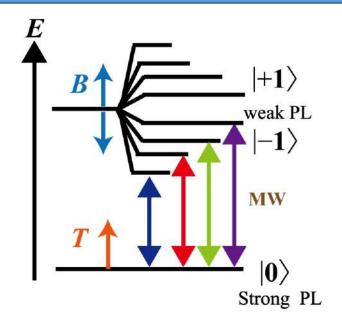


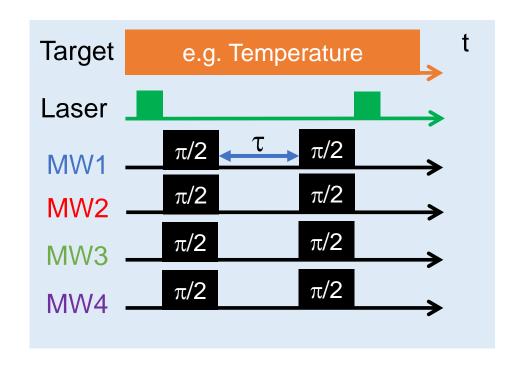


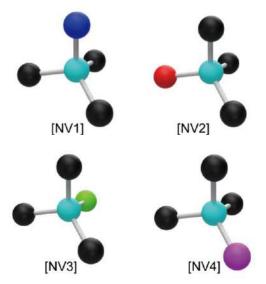
NVセンターを用いた温度センシング



多周波での温度センシング





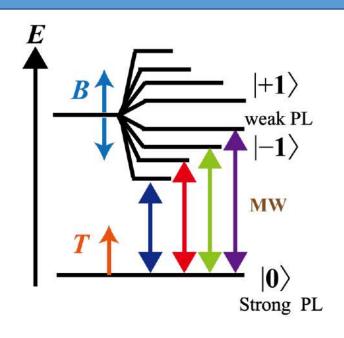


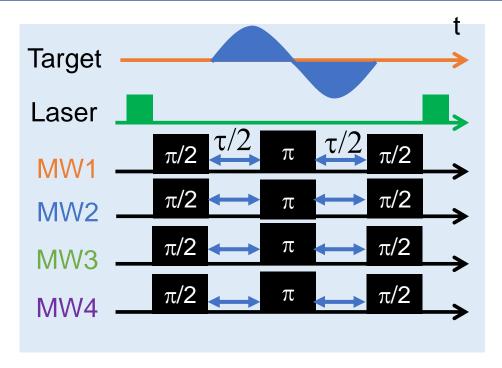
Sensitivity(η) rate(sample with same orientation)

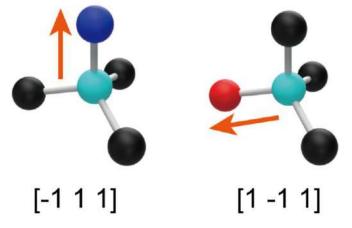
$$\frac{\eta_{single}}{\eta_{multi}} = 2\sqrt{2}$$

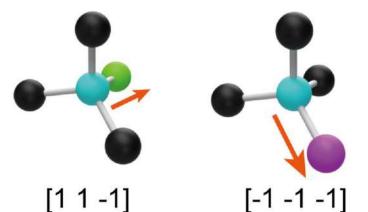
Katsuya.n, the 81st JSAP Autumn Meeting, Japan (2020)

多周波での交流磁場センシング

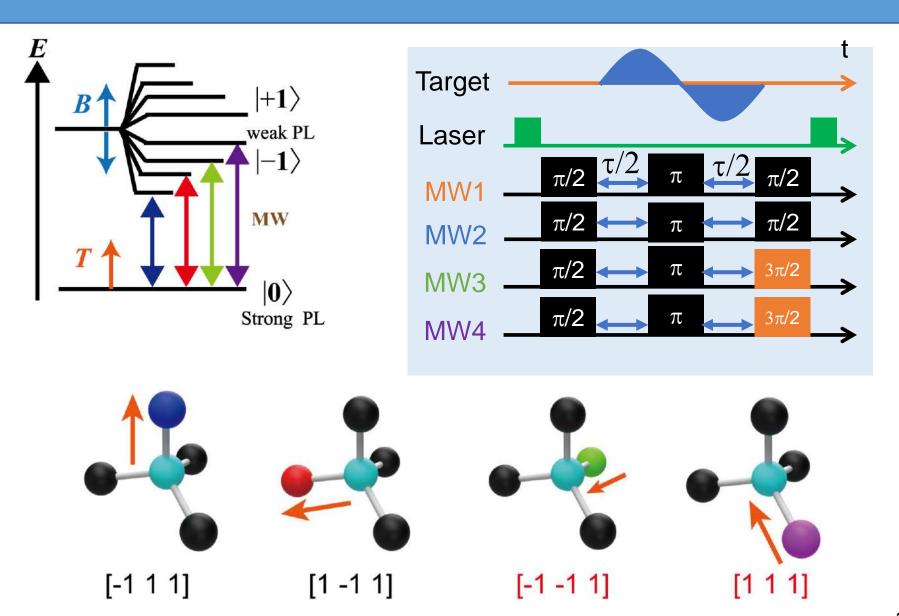




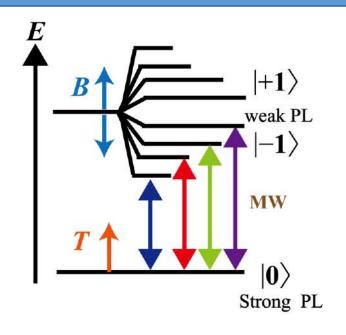


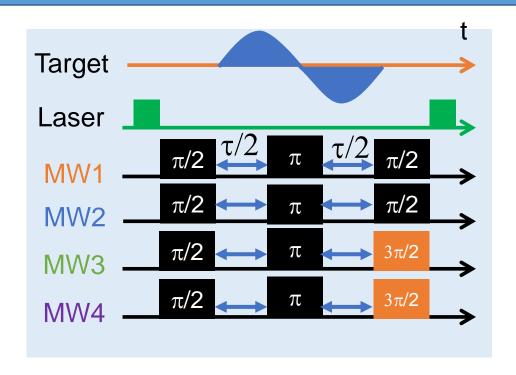


多周波での交流磁場センシング



多周波での交流磁場センシング

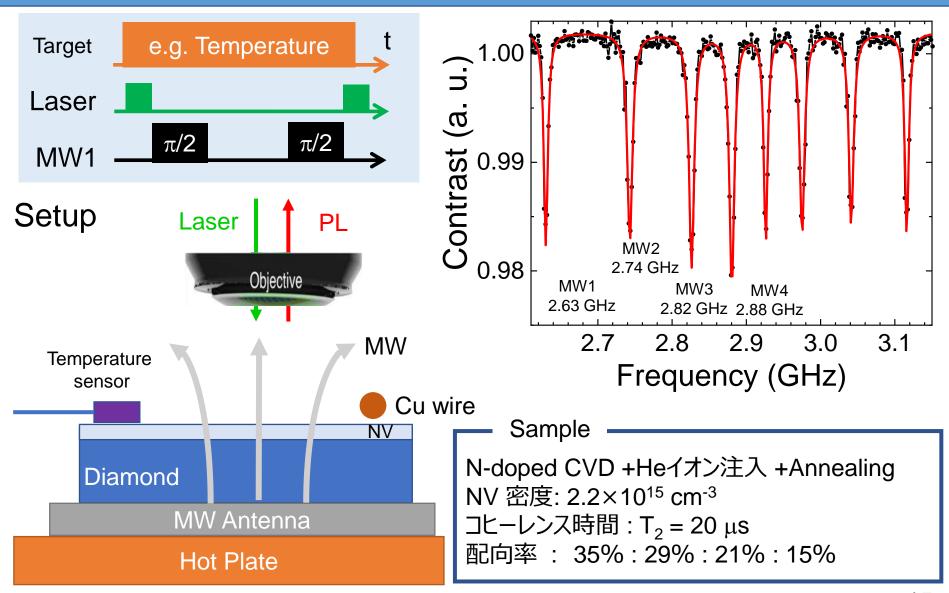




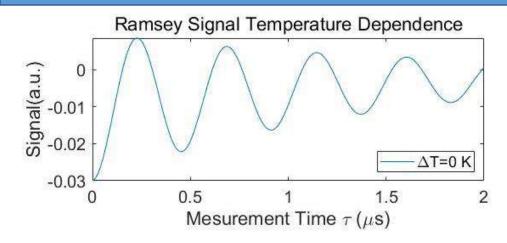
	Sequence	Target
ラムゼー	$\pi/2$ τ $\pi/2$	DC Mag. Temperature
スピンエコー	$\tau/2$ $\pi/2$ $\pi/2$	AC Mag.

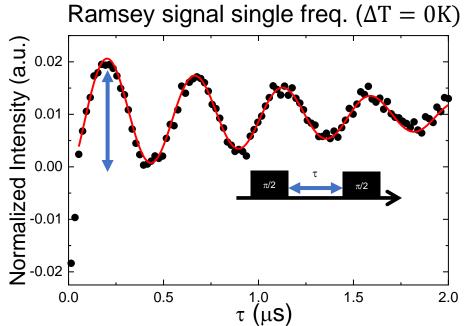
- 1. 研究背景
 - ・NVセンター
 - ・単一周波制御と多周波制御
- 2. 測定理論
 - ・エネルギー準位
 - ・ラムゼーシークエンス
 - ·多周波制御測定
- 3. 実験結果
- 4. まとめ

実験系



ラムゼー干渉測定

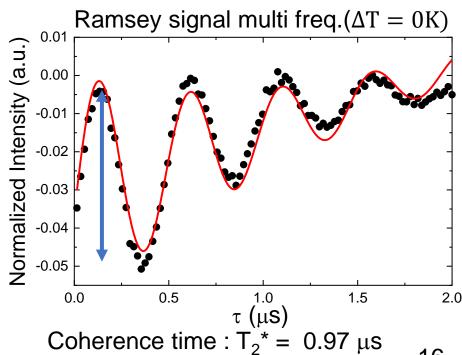




Coherence time : $T_2^* = 1.30 \mu s$

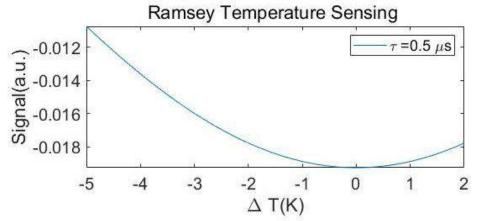
Intensity rate

$$\frac{I_{\text{multi}}}{I_{\text{single}}} = 2.5$$



16

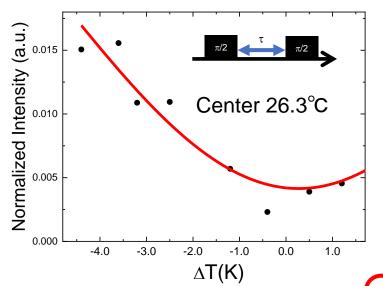
温度センシング



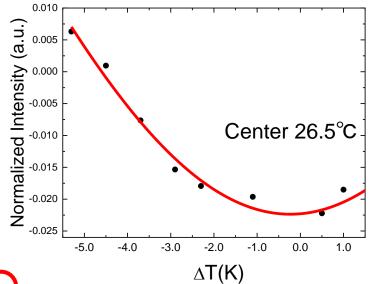
Theoretical

$$\frac{\eta_{single}}{\eta_{multi}} > 2\sqrt{2} \approx 2.8$$

Temperature sensing single freq.($\tau = 0.5 \mu s$)



Temperature sensing multi freq.($\tau = 0.5 \mu s$)

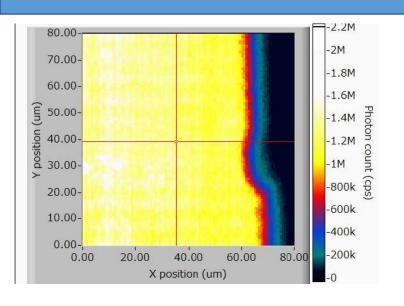


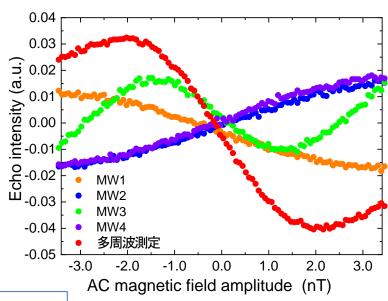
Sensitivity 242 mK/√Hz

 $\frac{\eta_{\text{single}}}{\eta_{\text{multi}}} > 1.8$

Sensitivity 134 mK/√Hz

交流磁場センシング





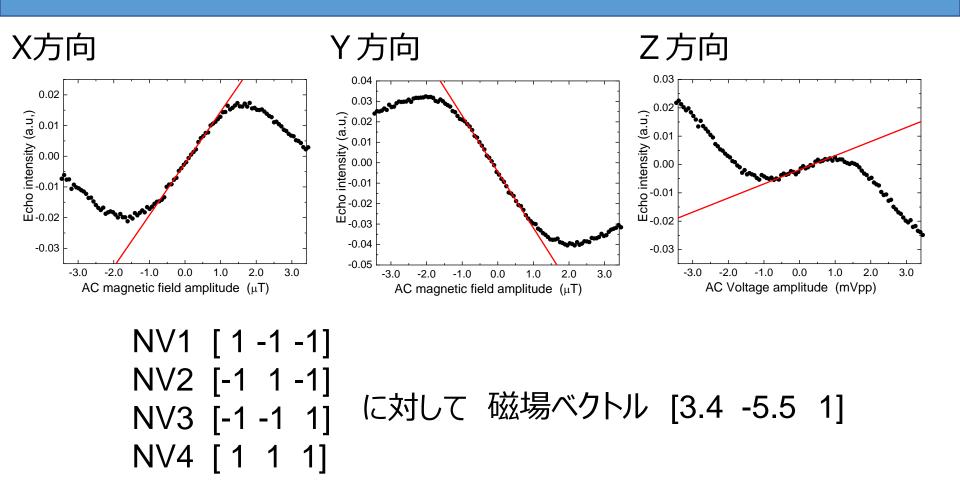
Sensitivity

MW1 625 nT/√Hz MW2 474 nT/√Hz MW3 684 nT/√Hz MW4 581 nT/√Hz

Multi 177 nT/√Hz

$$\frac{\eta_{\text{single}}}{\eta_{\text{multi}}} > 2.67$$

ベクトル磁場測定



ベクトル磁場測定

- 1. 研究背景
 - ・NVセンター
 - ・単一周波制御と多周波制御
- 2. 測定理論
 - ・エネルギー準位
 - ・ラムゼーシークエンス
 - ·多周波制御測定
- 3. 実験結果
- 4. まとめ

まとめ

研究目的

多周波制御センシングを用いた 温度とベクトル磁場の複合測定

結論

- ・温度測定系を構築し、温度センシングにおいて 多周波制御が単一周波制御に比べ高感度になることを実証した。
- ・同一セットアップによって温度と磁場の複合センシングを行った。

展望

- より高感度な測定が可能なシークエンスを用いて評価を行う
- 磁場と温度が同時に印加された時の影響の評価を行う